

Title (en)

Electrostatic deflection system for corpuscular radiation

Title (de)

Elektrostatisches Ablensystem für Korpuskularstrahlung

Title (fr)

Système de déviation électrostatique pour rayonnement corpusculaire

Publication

EP 1688964 A2 20060809 (DE)

Application

EP 06002118 A 20060202

Priority

DE 102005005801 A 20050204

Abstract (en)

An electrostatic diffraction system for corpuscular radiation for micro- and nano-structure lithography or measurement comprises bar electrodes held axially and symmetrically in an inner hollow carrier (1) through which an electron beam is directed. The carrier comprises between two and four mutually connectible carrier elements (1.1, 1.2).

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft elektrostatische Ablensysteme für Korpuskularstrahlen, die insbesondere für mikro- und nanostrukturierte Anwendungen in Lithographieanlagen oder Messgeräten einsetzbar sind. Gemäß der gestellten Aufgabe sollen die einzelnen Elektroden eines solchen Ablensystems dauerhaft eine sehr genaue axialsymmetrische Anordnung zueinander aufweisen und beibehalten. Bei dem erfindungsgemäßen elektrostatischen Ablensystem sind stabförmige Elektroden in axialsymmetrischer Anordnung in einem innen hohlen Träger gehalten, durch den ein Korpuskularstrahl gerichtet werden kann. Der Träger ist dabei aus mindestens zwei und maximal vier miteinander verbindbaren Trägerelementen gebildet.

IPC 8 full level

G21K 1/087 (2006.01)

CPC (source: EP US)

G21K 1/087 (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1688964 A2 20060809; EP 1688964 A3 20080813; DE 102005005801 A1 20060817; DE 102005005801 B4 20070809; JP 2006216558 A 20060817; US 2006192133 A1 20060831; US 7491946 B2 20090217

DOCDB simple family (application)

EP 06002118 A 20060202; DE 102005005801 A 20050204; JP 2006027127 A 20060203; US 34666606 A 20060203